3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年10月26日から平成23年11月28日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年11月２日14時00分
⑵　開催場所　東京工業大学財務部契約課入札室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Library computer system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　This system is a library computer system. The system should have high speed and the stable performance, and carry out continuous operation of the long period of time.
B　The system should be developed on a client-server system. The system should manage data and program in the server-side as much as possible. Put minimum program and data in the clients-side.
C　The system should connect with Tokyo Institute of Technology high-speed campus information network (Titanet3) after giving required and sufficient security management, and share the system resources.
D　The system should build the thoroughgoing backup function of a system and data. Moreover, the maintenance service should be able to act immediately for the obstacle of a system etc.
E　The system should be able to correspond to the Institute's campus and user situation where there are three campuses such as, Ookayama, Suzukakedai, Tamachi, and two libraries such as Ookayama Library and Suzukakedai Library.
F　The system should totally manage the library services, including ordering, acquisition, payment, registration, cataloging, circulation, interlibrary loan, and information retrieval services with the newest functions of NII (National Institute of Informatics) NACSIS-CAT／ILL system. The system should have automated modules on each function in cooperation with the Institute's financial management system and vendor's ordering system.
G　The system should be able to accumulate electronically the various scientific data which the Institute owns, and to retrieve them.
H　The system should provide cross-searching and integrated information service in terms of the databases held on this system, Institutional Repository of the Institute (Tokyo Tech STAR), researcher information retrieval system of the Institute, external databases, and electronic journals, etc.
I　The system should be able to provide the application, situation check, and the reply to the users via WWW browsers about document delivery service and reference service, etc.
J　The system should be able to authenticate members who belong to the Institute by using the Institute's Campus-wide and Authorization System.
K　The system should improve flexibly for changes and extensibility in terms of technical progress, efficiency and specifications of external systems.
L　Swift and smooth migration from the present system should be ensured, including the inheritance of current property.
M　The contractor should carry out the education and training for library staff for smooth operation after the system introduction.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 28, November, 2011
⑹　Contact point for the notice : Naoki Okuda, Contract Division, Finance Department, Tokyo Institute of Technology, 2—12—1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152—8550 Japan, TEL 03—5734—2353

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成 23 年 10 月 26 日

国立大学法人名古屋工業大学
事務局長　前田　千尋

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23

○第１号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　有機金属気相成長装置システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　ＭＯＣＶＤ装置（２台）　多数枚の基板上に常圧及び減圧下でＧａＮ系薄膜が形成出来ること。成長中にその場観察が可能なこと。
B　ドライ洗浄装置　ＭＯＣＶＤ装置で使用する反応炉内高純度石英製リアクター内部品を加熱下、塩素系ガスでエッチング出来ること。
C　配管設備　ＭＯＣＶＤ装置への原料供給設備、除害設備、ドライ洗浄装置、ガス警報設備及びこれらを結ぶ配管を有すること。
D　供給設備　ＭＯＣＶＤ装置用に有機金属系、水素化物系、キャリアガス及びドライ洗浄装置用に塩素系ガスを有すること。
E　除害設備　ＭＯＣＶＤ装置やドライ洗浄装置から排出されるガスの除害塔、中和するための薬液及び廃液タンクを有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成23年12月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒466—8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番　名古屋工業大学経理チームマネージャー（領域担当）　川那　武史　電話052—735—5039
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年10月26日から平成23年12月１日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年11月７日10時00分
⑵　開催場所　名古屋工業大学事務局会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Metal Organic Chemical Vapor Deposition Equipment System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　MOCVD (2 equipments) : MOCVD facility is capable of growing Gallium Nitride related thin-films on multi-substrates under both atmospheric and low pressure. In-situ monitoring during crystal growth is required.
B　Dry Cleaning Facility : Dry cleaning facility is capable of cleaning high-purity quartz parts used in MOCVD reactors by chlorine gas under heat.
C　Piping System : Piping system includes ; supply facilities, MOCVDs, gas abatement facilities, dry cleaning facility, and gas alarm system.